

JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL JURUSAN TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWA

HARI	JAM KE	WAKTU	KELAS : TRIK 4.A			KELAS : TRIK 4.B		
			MATA KULIAH	DS	R	MATA KULIAH	DS	R
S E N I N	1	07.30-08.10	Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R29	Sistem Kendali Diskrit	WDM	R26
	2	08.10-08.50	Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R29	Sistem Kendali Diskrit	WDM	R26
	3	08.50-09.30	Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R29	Sistem Kendali Diskrit	WDM	R26
	4	09.30-10.10	Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R29	Sistem Kendali Diskrit	WDM	R26
		10.10-10.30						
	5	10.30-11.10	Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R29			
	6	11.10-11.50	Sistem Kendali Diskrit	MHM	R29			
	7	11.50-12.30	Sistem Kendali Diskrit	MHM	R29			
		12.30-13.10						
	9	13.10-13.50	Sistem Kendali Diskrit	MHM	R29			
	10	13.50-14.30	Sistem Kendali Diskrit	MHM	R29			
	11	14.30-15.10						
	12	15.10-15.50						
		15.50-16.10						
S E L A S A		16.10-16.50						
	1	07.30-08.10				Lab. Robotika	ADF	L19
	2	08.10-08.50				Lab. Robotika	ADF	L19
	3	08.50-09.30				Lab. Robotika	ADF	L19
	4	09.30-10.10				Lab. Robotika	ADF	L19
		10.10-10.30						
	5	10.30-11.10	Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8	Lab. Robotika	ADF	L19
	6	11.10-11.50	Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8	Lab. Robotika	ADF	L19
	7	11.50-12.30	Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8			
		12.30-13.10						
	9	13.10-13..50	Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8			
	10	13.50-14.30	Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8			
	11	14.30-15.10						
	12	15.10-15.50						
		15.50-16.10						
R A B U		16.10-16.50						
	1	07.30-08.10	Instrumentasi Optik dan Laser	ANF	R28	Sistem Kendali Terdistribusi	YS	R8
	2	08.10-08.50	Instrumentasi Optik dan Laser	ANF	R28	Sistem Kendali Terdistribusi	YS	R8
	3	08.50-09.30	Instrumentasi Optik dan Laser	ANF	R28	Sistem Kendali Terdistribusi	YS	R8
	4	09.30-10.10	Instrumentasi Optik dan Laser	ANF	R28	Sistem Kendali Terdistribusi	YS	R8
		10.10-10.30						
	5	10.30-11.10	Sistem Kendali Terdistribusi	YS	R28	Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8
	6	11.10-11.50	Sistem Kendali Terdistribusi	YS	R28	Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8
	7	11.50-12.30	Sistem Kendali Terdistribusi	YS	R28	Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8
		12.30-13.10						
	9	13.10-13..50	Sistem Kendali Terdistribusi	YS	R28	Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8
	10	13.50-14.30				Lab. Sistem Kendali Proses	MKH	L8
	11	14.30-15.10						
	12	15.10-15..50						
		15.50-16.10						
K A M I S		16.10-16.50						
		16.50-17.30						
	1	07.30-08.10	Lab. Elektronika Industri	NSR	L18	Instrumentasi Optik dan Laser	ANF	R28
	2	08.10-08.50	Lab. Elektronika Industri	NSR	L18	Instrumentasi Optik dan Laser	ANF	R28
	3	08.50-09.30	Lab. Elektronika Industri	NSR	L18	Instrumentasi Optik dan Laser	ANF	R28
	4	09.30-10.10	Lab. Elektronika Industri	NSR	L18	Instrumentasi Optik dan Laser	ANF	R28
		10.10-10.30						
	5	10.30-11.10	Lab. Elektronika Industri	NSR	L18	Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R28
	6	11.10-11.50	Lab. Elektronika Industri	NSR	L18	Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R28
	7	11.50-12.30				Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R28
		12.30-13.10						
	9	13.10-13..50				Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R28
	10	13.50-14.30				Sistem Kendali Kontinyu	MKH	R28
	11	14.30-15.10						
	12	15.10-15..50						
J U M A T		15.50-16.10						
		16.10-16.50						
		16.50-17.30						
	1	07.30-08.10	Lab. Robotika	JML	L19	Lab. Elektronika Industri	ADF	L18
	2	08.10-08.50	Lab. Robotika	JML	L19	Lab. Elektronika Industri	ADF	L18
	3	08.50-09.30	Lab. Robotika	JML	L19	Lab. Elektronika Industri	ADF	L18
	4	09.30-10.10	Lab. Robotika	JML	L19	Lab. Elektronika Industri	ADF	L18
		10.10-10.30						
	5	10.30-11.10	Lab. Robotika	JML	L19	Lab. Elektronika Industri	ADF	L18
	6	11.10-11.50	Lab. Robotika	JML	L19	Lab. Elektronika Industri	ADF	L18
		11.50-12.30						
		12.30-13.10						
		13.10-13..50						
	10	13.50-14.30						
	11	14.30-15.10						
	12	15.10-15..50						
		15.50-16.10						
		16.10-16.50						
	14	16.50-17.30						

Berlaku untuk 24 Nopember 2018 sampai seterusnya